

主催：(一財)岡山セラミックス技術振興財団

共催：日本セラミックス協会中国四国支部、耐火物技術協会中国四国支部、ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社、株式会社猪原商会

レッチェ：粉物のトータルソリューションを提供

粗粉碎～微粉碎・ふるい分け・縮分・

画像式粒度分布装置 紹介セミナー

分析前に必要となる前処理、目的に即した装置を選定する事で、正確な分析には欠かせない代表性、再現性のある試料作製が可能になります。試料粉碎から粉碎後の粒度分布測定までの一連の流れを、創業100年を迎えたレッチェからそのノウハウの講義をしていただきますので、関係各位多数の御参加をお願いします。

日時

平成29年6月2日(金) 13:00~16:15

会場

岡山セラミックスセンター セミナー室
(備前市西片上1406番地18)

定員

50名

受講料

無料

申込方法

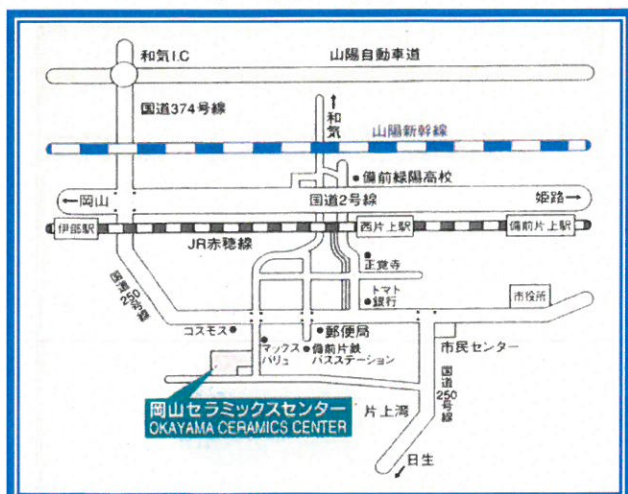
別紙お申込書に必要事項をご記入の上、FAXかメールにてご送信ください。
(一財)岡山セラミックス技術振興財団 担当：川端(かわばた)
TEL 0869-64-0505 FAX 0869-63-0227
Email: erazoku@optic.or.jp

申込〆切

平成29年5月26日(金)

アクセス

JR岡山駅から約30km
JR赤穂線で45分 西片上駅下車徒歩約8分
車で約1時間



プログラム

時 間	項 目 / 概 要
13:00-13:05	<p>開会あいさつ 一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団 理事長 吉鷹 啓</p>
13:05-14:05	<p>「実験用粉碎機のレッチェ：粗粉碎～微粉碎 ふるい分け、縮分機等の紹介」 ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社 プロダクトマネージャー 二 宮 苗 央</p> <p>【概 要】 分析前に必要となる前処理。目的に即した装置を選定することで、正確な分析には欠かせない代表性、再現性のある試料作製が可能になります。創業100年を迎えたレッチェがそのノウハウを伝えます。</p>
14:05-14:10	休 憩
14:10-15:10	<p>「画像式粒度分布装置測定法とその他（レーザー、ふるい試験、顕微鏡）の測定方法との違い」 ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社 プロダクトマネージャー 松 脇 崇 晃</p> <p>【概 要】 現在、粒度分布測定には様々な方法がありますが、それぞれの測定法を正しく理解することで、研究目的に合った装置を選定することができます。本発表では、それぞれの測定法の違いの部分にフォーカスします。</p>
15:10-15:15	休 憩
15:15-16:15	<p>「画像解析式についての詳細な測定原理と、カムサイザーシリーズの具体的な用途例、画像例等」 ヴァーダー・サイエンティフィック株式会社 プロダクトマネージャー 松 脇 崇 晃</p> <p>【概要】 近年、粒度分布測定法のデファクトスタンダードとなりつつある画像式粒度分布測定法の原理や実際の測定データ、画像例等を詳細に紹介します。</p>
16:15	閉 会

粗粉碎～微粉碎・ふるい分け・縮分・画像式粒度分布装置 紹介セミナー参加申込書

平成 年 月 日

(一財)岡山セラミックス技術振興財団 御中

〒
住 所

会社名

申込者氏名

TEL
E-mail

FAX

以下のとおり参加申し込みます。

参加者氏名

氏 名	所属、役職	備考

講義の中でお聞きになりたいこと、質問事項などを講師へ事前に伝達いたします。

質問事項